

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

PCT/JP 00/08860

14.12.00

Priority
8/12/00
45

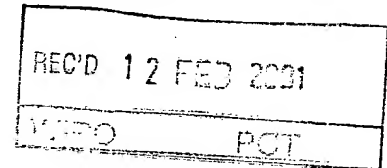
4

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2000年 4月 6日

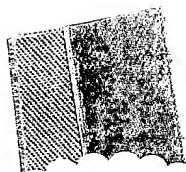


出願番号
Application Number:

特願2000-104664

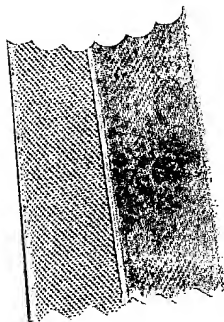
出願人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社



PRIORITY
DOCUMENT

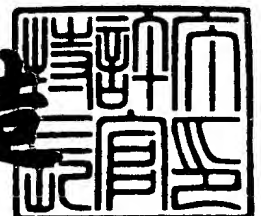
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2001年 1月26日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3114960

【書類名】 特許願

【整理番号】 2173510028

【提出日】 平成12年 4月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01R 33/00

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
 会社内

 【氏名】 松川 恭範

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
 会社内

 【氏名】 松浦 昭

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
 会社内

 【氏名】 上田 真二郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000005821

 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100097445

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

 【識別番号】 100103355

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第354310号

【出願日】 平成11年12月14日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 非接触型位置センサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 N 極と S 極を有する磁石と、この磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁性体における先端部間に位置して少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記磁性体における先端部間または前記磁性体における先端部と前記磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるようにした非接触型位置センサ。

【請求項 2】 N 極と S 極を有する磁石と、この磁石の N 極と S 極に接するよう設けられ、かつ前記磁石から発生する磁束の流れを集磁する 2 個の磁性体とにより磁気回路を構成し、前記 2 個の磁性体はそれぞれの先端部を略 L 字形状にするとともに、その先端部間に空隙を有し、かつ前記 2 個の磁性体のそれぞれの先端部のうち、いずれか一方、もしくは両方に少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記空隙内に相手側回動軸を設けるようにした非接触型位置センサ。

【請求項 3】 相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状に構成した請求項 1 または 2 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 4】 相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を半円形状に構成した請求項 1 または 2 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 5】 磁性体の先端部を傾斜させた請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の非接触型位置センサ。

【請求項 6】 N 極と S 極を有する磁石と、この磁石の N 極あるいは S 極を側面の略中央に固着するとともに両端の先端部を略 L 字形状とし、かつ前記磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁石における磁性体の側面に固着した極とは反対側の極と前記磁性体における両端部との間に空隙を形成するとともに、前記磁性体の両端の先端部のうち、いずれか一方に少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記空隙内に相手側回動軸を設けるようにした非接触型位置センサ。

【請求項 7】 相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を I 形状に構

成した請求項 6 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 8】 N 極と S 極を有する第 1 の磁石と、この第 1 の磁石と対向するとともに N 極と S 極を有する第 2 の磁石と、一端部側の内側面に前記第 1 の磁石における N 極あるいは S 極を固着するとともに他端部側の内側面に第 2 の磁石における S 極あるいは N 極を固着し、かつ中間部の内側面に磁気検出素子を設けた磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁気検出素子と第 1 の磁石および第 2 の磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるように構成した非接触型位置センサ。

【請求項 9】 磁性体をコ字形状に構成した請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 10】 磁性体における一端部側と他端部側を接続する補強磁性体を設けた請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 11】 磁性体の中間部における磁気検出素子を設ける部分の厚みを磁気検出素子を設けない部分の厚みより小さくした請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 12】 第 1 の磁石および第 2 の磁石の幅を相手側回動軸の直径に略一致させた請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 13】 相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状にした請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【請求項 14】 相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を半円形状にした請求項 8 記載の非接触型位置センサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、磁気の変化により回転位置を検出する非接触型位置センサに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来のこの種の非接触型位置センサとしては、特開平 2 - 2 4 0 5 8 5 号公報

に開示されたものが知られている。

【0003】

以下、従来の非接触型位置センサについて、図面を参照しながら説明する。

【0004】

図17は従来の非接触型位置センサの分解斜視図、図18は同非接触型位置センサの側断面図である。

【0005】

図17、図18において、1はN極とS極を有する磁石である。2は第1の磁性体で、この第1の磁性体2には前記磁石1を固着している。3は第2の磁性体で、この第2の磁性体3の一端部3aは前記第1の磁性体2の一端部2aと対向する位置に設けられている。4は磁気検出素子で、この磁気検出素子4は前記第2の磁性体3の側面に設けられるとともに、前記磁石1と対向する位置に設けられている。5は樹脂製のケースで、この樹脂製のケース5は前記磁石1、第1の磁性体2、第2の磁性体3および磁気検出素子4を内側に収納するとともに、コネクタ部6を設けており、そしてこのコネクタ部6には一体にコネクタ端子7を設け、さらにこのコネクタ端子7は一端をケース5の内側に配設するとともに、他端を外方へ向かって突出させている。また、前記ケース5におけるコネクタ端子7の一端は前記磁気検出素子4から引き出されたリード端子8と電氣的に接続されている。9は樹脂製の蓋で、この蓋9は前記ケース5の開口部を閉塞している。

【0006】

以上のように構成された従来の非接触型位置センサについて、次にその動作を説明する。

【0007】

上記従来の非接触型位置センサは、第1の磁性体2の一端部2aと第2の磁性体3の一端部3aが対向するギャップ部および磁石1と磁気検出素子4が対向するギャップ部に、相手側回動軸（図示せず）に垂直方向に取り付けられ、かつ相手側回動軸と一体に回転する磁束シャッタ（図示せず）が挿入され、そしてこの磁束シャッタ（図示せず）のラジアル方向への移動により磁気検出素子4に到達

する磁石 1 の磁束密度が変化し、この磁束密度の変化を磁気検出素子 4 により出力信号として出力し、そしてこの出力信号をリード端子 8 およびコネクタ部 6 におけるコネクタ端子 7 を介して相手側のコンピュータ等へ出力し、相手側回動軸（図示せず）の回転角度を検出するものである。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の構成においては、第 1 の磁性体 2 の一端部 2 a と第 2 の磁性体 3 の一端部 3 a との間のギャップ部および磁石 1 と磁気検出素子 4 との間のギャップ部に磁束シャッタ（図示せず）が挿入される構成となっているため、相手側回動軸（図示せず）が偏芯した場合、相手側回動軸の先端部側に垂直方向に取り付けられた磁束シャッタのギャップ部への挿入度合は大きく変動するもので、このように大きく変動すると、磁束シャッタで磁気検出素子 4 に対する磁束をオン、オフさせることにより相手側回動軸の回転角度の検出を行うようにしたものにおいては、相手側回動軸の回転角度の検出が正確に行えないという課題を有していた。

【 0 0 0 9 】

また相手側回動軸の先端部側に垂直方向に磁束シャッタを取り付けた構成であるため、構造的にも複雑になるとともに、非接触型位置センサを相手側回動軸に精度良く組み付けるために、両者を近接させて組み付ける場合、磁束シャッタの存在により、非接触型位置センサを相手側回動軸の近傍に容易に組み付けることができないという課題を有していた。

【 0 0 1 0 】

本発明は上記従来の課題を解決するもので、相手側回動軸が偏芯した場合でも相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行えるとともに、非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、両者を近接させて容易に組み付けることができる非接触型位置センサを提供することを目的とするものである。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明の非接触型位置センサは、N極とS極を有する磁石と、この磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁性体における先端部間に位置して少なくとも1個の磁気検出素子を設け、さらに前記磁性体における先端部間または前記磁性体における先端部と前記磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたもので、この構成によれば、相手側回動軸が偏芯した場合でも相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行えたとともに、非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、両者を近接させて容易に組み付けることができるものである。

【 0 0 1 2 】

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、N極とS極を有する磁石と、この磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁性体における先端部間に位置して少なくとも1個の磁気検出素子を設け、さらに前記磁性体における先端部間または前記磁性体における先端部と前記磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたもので、この構成によれば、相手側回動軸の回転角度により、磁性体における先端部間または磁性体における先端部と磁石との間に形成される空隙内に生じる磁束密度が変化するものであり、したがって、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を設けることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができ、また相手側回動軸が偏芯した場合でも、従来のように相手側回動軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行え、さらに非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 3 】

請求項2に記載の発明は、N極とS極を有する磁石と、この磁石のN極とS極に接するように設けられ、かつ前記磁石から発生する磁束の流れを集磁する2個

の磁性体とにより磁気回路を構成し、前記 2 個の磁性体はそれぞれの先端部を略 L 字形状にするとともに、その先端部間に空隙を有し、かつ前記 2 個の磁性体のそれぞれの先端部のうち、いずれか一方、もしくは両方に少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたもので、この構成によれば、2 個の磁性体のそれぞれの先端部を略 L 字形状にするとともに、この 2 個の磁性体を前記磁石の N 極と S 極に接するように設けているため、前記磁石は 2 個の磁性体により挟持されることになり、これにより、非接触型位置センサに強い衝撃が加わった場合でも、2 個の磁性体と磁石とが強固に固着されているため、非接触型位置センサの耐衝撃性を向上させることができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 4 】

請求項 3 に記載の発明は、請求項 1 または 2 に記載の相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状に構成したもので、この構成によれば、相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状に構成しているため、相手側回動軸の回転角度により、相手側回動軸における空隙に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を必要とすることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 5 】

請求項 4 に記載の発明は、請求項 1 または 2 に記載の相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を半円形状に構成したもので、この構成によれば、相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を半円形状に構成しているため、相手側回動軸の回転角度により、相手側回動軸における空隙に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を必要とすることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 6 】

請求項 5 に記載の発明は、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の磁性体の先端部を傾斜させたもので、この構成によれば、磁性体の先端部を傾斜させているため、

磁性体の先端部間の磁束密度が磁石に近づくにしたがって大きくなるとともに、相手側回動軸における扇形状あるいは半円形状の空隙内に突出する速度が相手側回動軸の回転角度とともに小さくなり、その結果、相手側回動軸の回転角度に伴い磁気検出素子を通過する磁束密度の直線性を向上させることができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 7 】

請求項 6 に記載の発明は、N 極と S 極を有する磁石と、この磁石の N 極あるいは S 極を側面の略中央に固着するとともに両端の先端部を略 L 字形状とし、かつ前記磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁石における磁性体の側面に固着した極とは反対側の極と前記磁性体における両端部との間に空隙を形成するとともに、前記磁性体の両端の先端部のうち、いずれか一方に少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたもので、この構成によれば、磁石における磁性体の側面に固着した極とは反対側の極と前記磁性体における両端部との間に形成された空隙内に相手側回動軸を設けているため、相手側回動軸が偏芯した場合でも、従来のように相手側回動軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行え、また非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 8 】

請求項 7 に記載の発明は、請求項 6 に記載の相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を I 形状に形成したもので、この構成によれば、相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を I 形状に構成しているため、I 形状の長手方向の両端部が磁石および磁性体における磁気検出素子を設けた一方の先端部の近傍に位置するときには他方の先端部の近傍に相手側回動軸が存在しないことになり、一方、I 形状の長手方向の両端部が磁石および磁性体における磁気検出素子を設けない他方の先端部の近傍に位置するときには一方の先端部の近傍に相手側

回動軸が存在しないことになり、これにより、磁性体における一方の先端部の磁力が密になると他方の先端部の磁力が疎となるため、相手側回動軸の回転角度に伴う磁気検出素子を通過する磁束密度の直線性を向上させることができるという作用を有するものである。

【 0 0 1 9 】

請求項 8 に記載の発明は、N 極と S 極を有する第 1 の磁石と、この第 1 の磁石と対向するとともに N 極と S 極を有する第 2 の磁石と、一端部側の内側面に前記第 1 の磁石における N 極あるいは S 極を固着するとともに他端部側の内側面に第 2 の磁石における S 極あるいは N 極を固着し、かつ中間部の内側面に磁気検出素子を設けた磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁気検出素子と第 1 の磁石および第 2 の磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるように構成したもので、この構成によれば、磁気検出素子と第 1 の磁石および第 2 の磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けているため、相手側回動軸が偏芯した場合でも、従来のように相手側回動軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行え、また非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるという作用を有するものである。

【 0 0 2 0 】

請求項 9 に記載の発明は、請求項 8 に記載の磁性体をコ字形状に構成したもので、この構成によれば、磁性体をコ字形状に構成しているため、磁性体の一端部側に設けた第 1 の磁石と磁性体の他端部側に設けた第 2 の磁石とが磁力線に対して垂直に配設されることになり、これにより、磁気回路内を流れる磁力線が増加するため、非接触型位置センサの出力感度が向上するという作用を有するものである。

【 0 0 2 1 】

請求項 1 0 に記載の発明は、請求項 8 に記載の磁性体における一端部側と他端部側を接続する補強磁性体を設けたもので、この構成によれば、磁性体における

一端部側と他端部側を接続する補強磁性体を設けているため、磁性体における一端部側と他端部側との間隙から外部に漏れようとする磁力線を補強磁性体により吸収して磁気回路を構成することができ、これにより、磁気検出素子を通過する磁力線の量が増加するため、非接触型位置センサの出力感度が向上するという作用を有するものである。

【 0 0 2 2 】

請求項 1 1 に記載の発明は、請求項 8 に記載の磁性体の中間部における磁気検出素子を設ける部分の厚みを磁気検出素子を設けない部分の厚みより小さくしたもので、この構成によれば、磁性体における磁気検出素子を設ける部分の厚みを磁気検出素子を設けない部分の厚みより小さくしているため、磁性体を流れる磁力線は磁気検出素子を設ける部分で集磁されることになり、これにより、磁気検出素子を通過する磁力線の量が増加するため、非接触型位置センサの出力感度が向上するという作用を有するものである。

【 0 0 2 3 】

請求項 1 2 に記載の発明は、請求項 8 に記載の第 1 の磁石および第 2 の磁石の幅を相手側回動軸の直径に略一致させたもので、この構成によれば、第 1 の磁石および第 2 の磁石の幅を相手側回動軸の直径に略一致させているため、第 1 の磁石と第 2 の磁石との間を通過しようとする磁力線が相手側回動軸のない位置を通過するということとはなくなり、これにより、非接触型位置センサの出力特性が向上するという作用を有するものである。

【 0 0 2 4 】

請求項 1 3 に記載の発明は、請求項 8 に記載の相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状に構成したもので、この構成によれば、相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を扇形状に構成しているため、相手側回動軸の回転角度により、相手側回動軸における空隙に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を必要とすることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができるという作用を有するものである。

【 0 0 2 5 】

請求項 1 4 に記載の発明は、請求項 8 に記載の相手側回動軸における空隙に位置する部分の形状を半円形状に構成したもので、この構成によれば、相手側回動軸の空隙に位置する部分の形状を半円形状に構成しているため、相手側回動軸の回転角度により、相手側回動軸における空隙に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を必要とすることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができるという作用を有するものである。

【 0 0 2 6 】

(実施の形態 1)

以下、本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサについて、図面を参照しながら説明する。

【 0 0 2 7 】

図 1 は本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサの蓋および回路基板を外した状態の上面図、図 2 は同非接触型位置センサの側断面図である。

【 0 0 2 8 】

図 1、図 2 において、2 1 は磁石で、この磁石 2 1 は一端に N 極 2 2 を設けるとともに、他端には S 極 2 3 を設けている。2 4 は L 字形状に構成された第 1 の磁性体で、この第 1 の磁性体 2 4 の側面は前記磁石 2 1 における N 極 2 2 に当接させている。2 5 は L 字形状に構成された第 2 の磁性体で、この第 2 の磁性体 2 5 の側面は前記磁石 2 1 における S 極 2 3 に当接させている。このようにして前記磁石 2 1 は前記第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 により両側から強固に挟持されるものである。2 6 は例えばホール素子からなる磁気検出素子で、この磁気検出素子 2 6 は第 2 の磁性体 2 5 における L 字形状の先端部 2 5 a と対向するように、第 1 の磁性体 2 4 における L 字形状の先端部 2 4 a に固着されている。2 7 は回路基板で、この回路基板 2 7 の上面には電子部品からなる処理回路 2 8 を設けており、かつこの処理回路 2 8 は前記磁気検出素子 2 6 にリード端子 2 6 a を介して電氣的に接続されて前記磁気検出素子 2 6 で生じた出力信号を出力電圧に変換するものである。2 9 は樹脂製のケースで、このケース 2 9 は底面に孔 2 9 a を設けており、かつこの孔 2 9 a の上面に位置して、前記第 1 の磁性

体 2 4 における先端部 2 4 a および第 2 の磁性体 2 5 における先端部 2 5 a の端面を露出させるとともに、前記磁石 2 1、第 1 の磁性体 2 4、第 2 の磁性体 2 5 および回路基板 2 7 を内側に収納している。また前記ケース 2 9 の外側面には外方へ突出するようにコネクタ部 3 0 を設けており、かつこのコネクタ部 3 0 には一体にコネクタ端子 3 1 を設け、さらにこのコネクタ端子 3 1 は一端を前記回路基板 2 7 における処理回路 2 8 と電氣的に接続するとともに、他端を外方に向かって突出させている。3 2 は樹脂製の蓋で、この蓋 3 2 は前記ケース 2 9 における開口部を閉塞している。

【 0 0 2 9 】

以上のように構成された本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサについて、次にその組立方法を説明する。

【 0 0 3 0 】

まず、予め準備された磁石 2 1 の N 極および S 極に第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 の側面を接着剤等により固着し、第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 により前記磁石 2 1 を挟持する。

【 0 0 3 1 】

次に、第 1 の磁性体 2 4 における L 字形状の先端部 2 4 a に磁気検出素子 2 6 を貼り付けにより取り付けした後、第 1 の磁性体 2 4、第 2 の磁性体 2 5 および磁石 2 1 を予め孔 2 9 a を設けたケース 2 9 の内側に収納する。

【 0 0 3 2 】

次に、第 1 の磁性体 2 4、第 2 の磁性体 2 5 および磁石 2 1 を収納したケース 2 9 の内側に位置して、前記第 1 の磁性体 2 4、第 2 の磁性体 2 5 および磁石 2 1 の上面に予め処理回路 2 8 を設置した回路基板 2 7 を載置する。

【 0 0 3 3 】

次に、磁気検出素子 2 6 におけるリード端子 2 6 a と電子部品からなる処理回路 2 8 とをのはんだ付けにより電氣的に接続した後、処理回路 2 8 とケース 2 9 におけるコネクタ端子 3 1 とをのはんだ付けにより電氣的に接続する。

【 0 0 3 4 】

最後に、ケース 2 9 の開口部を蓋 3 2 で閉塞する。

【 0 0 3 5 】

以上のように構成され、かつ組み立てられた本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。

【 0 0 3 6 】

図 3 は本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサにおける孔に相手側回動軸を挿入した状態を示す断面図である。

【 0 0 3 7 】

図 3 において、33 は金属製の相手側回動軸で、この相手側回動軸 33 は前記ケース 29 の孔 29 a に挿入され、かつ先端部側に設けた扇形状部 34 を前記第 1 の磁性体 24 における先端部 24 a と第 2 の磁性体 25 における先端部 25 a との間に形成される空隙内に位置させている。

【 0 0 3 8 】

上記相手側回動軸 33 が回転すると、この回転に伴い、相手側回動軸 33 における扇形状部 34 が回転するため、この回転により、前記第 1 の磁性体 24 における先端部 24 a と第 2 の磁性体 25 における先端部 25 a との間に形成される空隙内に生じる磁束密度が変化するものである。

【 0 0 3 9 】

すなわち、図 4 (a) に示すように、相手側回動軸 33 における扇形状部 34 の回転角度が 0 度のときは、磁束密度は図 5 に示すように約 0.15 T であるが、図 4 (b) に示すように、回転角度が 90 度のときは、磁束密度は図 5 に示すように約 0.32 T となるものである。

【 0 0 4 0 】

そして前記第 1 の磁性体 24 における先端部 24 a および第 2 の磁性体 25 における先端部 25 a は傾斜させているため、第 1 の磁性体 24 の先端部 24 a と第 2 の磁性体 25 の先端部 25 a との間の磁束密度は磁石 21 に近づくにしがって大きくなるとともに、相手側回動軸 33 における扇形状部 34 の空隙内の突出する速度が相手側回動軸 33 の回転角度とともに小さくなるもので、これにより、相手側回動軸 33 の回転角度に伴う磁気検出素子 26 を通過する磁束密度の直線性を向上させることができるものである。

【 0 0 4 1 】

そして前記磁束密度の変化を磁気検出素子 2 6 により出力信号として検出し、この出力信号を回路基板 2 7 における処理回路 2 8 により出力電圧に変換し、かつコネクタ端子 3 1 を介して相手側コンピュータ等に出し、相手側回転軸 3 3 の回転角度を検出するものである。

【 0 0 4 2 】

上記本発明の実施の形態 1 においては、第 1 の磁性体 2 4 における先端部 2 4 a と第 2 の磁性体 2 5 における先端部 2 5 a との間に形成される空隙内に相手側回転軸 3 3 を設け、この相手側回転軸 3 3 の回転角度により、第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 における先端部 2 4 a, 2 5 a 間に形成される空隙内に生じる磁束密度を変化させる構成としているため、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を設けることなく、相手側回転軸 3 3 の回転角度を容易に検出することができるものである。また相手側回転軸 3 3 が偏芯した場合でも、従来のように相手側回転軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回転軸 3 3 の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回転軸 3 3 の回転角度の検出も正確に行えるものである。そしてまた非接触型位置センサを相手側回転軸 3 3 に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるものである。

【 0 0 4 3 】

また上記本発明の実施の形態 1 においては、相手側回転軸 3 3 における空隙に位置する部分の形状を扇形状部 3 4 としているため、相手側回転軸 3 3 の回転角度により、相手側回転軸 3 3 における空隙に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を必要とすることなく、相手側回転軸 3 3 の回転角度を容易に検出することができるという効果を有するものである。

【 0 0 4 4 】

そしてまた上記本発明の実施の形態 1 において、非接触型位置センサに強い衝撃が加わった場合を考えると、本発明の実施の形態 1 における非接触型位置

センサにおいては、第 1 の磁性体 2 4 における先端部 2 4 a と第 2 の磁性体 2 5 における先端部 2 5 a をそれぞれ略 L 字形状にするとともに、この第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 を前記磁石 2 1 の N 極 2 2 と S 極 2 3 に接するように設けているため、前記磁石 2 1 は第 1 の磁性体 2 4 と第 2 の磁性体 2 5 により挟持されることになり、これにより、非接触型位置センサに強い衝撃が加わった場合でも、第 1 の磁性体 2 4 および第 2 の磁性体 2 5 と磁石 2 1 とが強固に固着されているため、非接触型位置センサの耐衝撃性を向上させることができるものである。

【 0 0 4 5 】

なお、上記本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサにおいては、相手側回転軸 3 3 における空隙に位置する部分の形状を扇形状部 3 4 としたもののについて説明したが、半円形状に構成した場合でも、本発明の実施の形態 1 と同様の効果を有するものである。

【 0 0 4 6 】

(実施の形態 2)

以下、本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサについて図面を参照しながら説明する。

【 0 0 4 7 】

図 6 は本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサの蓋および回路基板を外した状態の上面図、図 7 は同非接触型位置センサの側断面図である。

【 0 0 4 8 】

図 6、図 7 において、4 1 は磁石で、この磁石 4 1 は一端に N 極 4 2 を設けるとともに、他端に S 極 4 3 を設けている。4 4 は磁性体で、この磁性体 4 4 は側面の略中央に前記磁石 4 1 における S 極 4 3 を固着するとともに、この磁性体 4 4 における両端の各々の先端部は L 字形状になるように構成している。4 5 は磁気検出素子で、この磁気検出素子 4 5 は前記磁性体 4 2 の一方の端部 4 4 a に位置して貼り付けにより取り付けられるとともに、この磁気検出素子 4 5 により磁石 4 1 における N 極 4 2 と磁性体 4 4 の一方の端部 4 4 a との間に形成される空隙内に生じた磁束密度を検出するものである。4 6 は回路基板で、この回路基板

4 6 の上面には電子部品からなる処理回路 4 7 を設けており、かつこの処理回路 4 7 は前記磁気検出素子 4 5 にリード端子 4 8 を介して電氣的に接続されて前記磁気検出素子 4 5 で生じた出力信号を出力電圧に変換するものである。4 9 は樹脂製のケースで、このケース 4 9 は内側に前記磁石 4 1 および磁性体 4 4 を収納するとともに、底面に孔 4 9 a を設けている。また前記ケース 4 9 は、外側面から外方へ向かって突出するようにコネクタ部 5 0 を設けており、そしてこのコネクタ部 5 0 の内側に一体に設けたコネクタ端子 5 1 により前記回路基板 4 6 の処理回路 4 7 に生じる出力電圧を出力するものである。5 2 は樹脂製の蓋で、この蓋 5 2 は前記ケース 4 9 の開口部を閉塞している。

【 0 0 4 9 】

以上のように構成された本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサについて、次にその組立方法を説明する。

【 0 0 5 0 】

まず、予め準備された磁石 4 1 の S 極 4 3 の先端面を磁性体 4 4 の側面の略中央に接着剤等により固着する。

【 0 0 5 1 】

次に、磁性体 4 4 の一方の端部 4 4 a に磁気検出素子 4 5 を貼り付けにより取り付けた後、この磁性体 4 4 および磁石 4 1 を予め孔 4 9 a を設けたケース 4 9 の内側に収納する。

【 0 0 5 2 】

次に、磁性体 4 4 および磁石 4 1 を収納したケース 4 9 の内側に位置して、前記磁性体 4 4 および磁石 4 1 の上面に予め処理回路 4 7 を設置した回路基板 4 6 を載置する。

【 0 0 5 3 】

次に、磁気検出素子 4 5 におけるリード端子 4 8 と電子部品からなる処理回路 4 7 とをはんだ付けにより電氣的に接続した後、処理回路 4 7 とケース 4 9 におけるコネクタ端子 5 1 とをはんだ付けにより電氣的に接続する。

【 0 0 5 4 】

最後に、ケース 4 9 の開口部を蓋 5 2 で閉塞する。

【 0 0 5 5 】

以上のように構成され、かつ組み立てられた本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。

【 0 0 5 6 】

図 8 は本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサの孔に相手側回動軸を挿入した状態を示す断面図である。

【 0 0 5 7 】

図 8 において、5 3 は I 型の相手側回動軸で、この相手側回動軸 5 3 は磁性体 4 4 における一方の端部 4 4 a、他方の端部 4 4 b および磁石 4 1 における N 極との間に形成される空隙内に位置させており、そしてこの相手側回動軸 5 3 における I 形状部 5 4 の回転により磁性体 4 4 の先端部 4 4 a と磁石 4 1 における N 極との間に形成される空隙内に生じる磁束密度が変化するものである。すなわち、図 9 (a) に示すように、相手側回動軸 5 3 における I 形状部 5 4 の回転角度が 0 度のときは、磁束密度は図 1 0 に示すように約 0. 1 5 T であるが、図 9 (b) に示すように、回転角度が 4 5 度のときは、磁束密度は図 1 0 に示すように約 0. 4 T となり、また図 9 (c) に示すように、回転角度が 9 0 度のときは、磁束密度は図 1 0 に示すように約 0. 6 7 T となるものである。

【 0 0 5 8 】

上記本発明の実施の形態 2 においては、相手側回動軸 5 3 における空隙に位置する部分の形状を I 形状部 5 4 としているため、I 形状部 5 4 の長手方向の両端部が磁石 4 1 および磁性体 4 4 における磁気検出素子 4 5 を設けた一方の先端部 4 4 a の近傍に位置するときには他方の先端部 4 4 b の近傍に相手側回動軸 5 3 が存在しないことになり、一方、I 形状部 5 4 の長手方向の両端部が磁石 4 1 および磁性体 4 4 における磁気検出素子 4 5 を設けない他方の先端部 4 4 b の近傍に位置するときには一方の先端部 4 4 a の近傍に相手側回動軸 5 3 が存在しないことになり、これにより、磁性体 4 4 における一方の先端部 4 4 a の磁力が密になると他方の先端部 4 4 b の磁力が疎となるため、相手側回動軸 5 3 の回転角度に伴う磁気検出素子 4 5 を通過する磁束密度の直線性を向上させることができるという効果を有するものである。

【 0 0 5 9 】

そして前記磁束密度の変化を磁気検出素子 4 5 により出力信号として検出し、この出力信号を回路基板 4 6 における処理回路 4 7 により出力電圧に変換し、かつコネクタ端子 5 1 を介して相手側コンピュータ等に出し、相手側回転軸 5 3 の回転角度を検出するものである。

【 0 0 6 0 】

上記本発明の実施の形態 2 においては、磁性体 4 4 における一方の端部 4 4 a 、他方の端部 4 4 b および磁石 4 1 における N 極との間に形成される空隙内に相手側回転軸 5 3 を設け、この相手側回転軸 5 3 の回転角度により、前記空隙内に生じる磁束密度を変化させる構成としているため、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を設けることなく、相手側回転軸 5 3 の回転角度を容易に検出することができるものである。また相手側回転軸 5 3 が偏芯した場合でも、従来のように相手側回転軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回転軸 5 3 の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回転軸 5 3 の回転角度の検出も正確に行えるものである。そしてまた非接触型位置センサを相手側回転軸 5 3 に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるものである。

【 0 0 6 1 】

(実施の形態 3)

以下、本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサについて、図面を参照しながら説明する。

【 0 0 6 2 】

図 1 1 は本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサの分解斜視図、図 1 2 は同非接触型位置センサの蓋を外した状態の上面図、図 1 3 は同非接触型位置センサの側断面図である。

【 0 0 6 3 】

図 1 1 ～図 1 3 において、6 1 は第 1 の磁石で、この第 1 の磁石 6 1 は一方の側面側に N 極 6 2 を設けるとともに、他方の側面側に S 極 6 3 を設けている。6

4は第2の磁石で、この第2の磁石64は前記第1の磁石61と対向するとともに、一方の側面側にN極65を設けるとともに、他方の側面側にS極66を設けている。67はコ字形状に構成された磁性体で、この磁性体67は一端部側の内側面に前記第1の磁石61におけるN極62を固着し、かつ他端部側の内側面に前記第2の磁石66におけるS極66を固着している。このように磁性体67はコ字形状に構成されているため、磁性体67の一端部側に設けた第1の磁石61と磁性体67の他端部側に設けた第2の磁石64とが磁力線に対して垂直に配設されることになり、これにより、磁気回路内を流れる磁力線が増加するため、非接触型位置センサの出力感度が向上するという効果を有するものである。

【0064】

68は例えばホール素子からなる磁気検出素子で、この磁気検出素子68は前記磁性体67における中間部69の内側面に設けている。そして前記磁性体67の中間部69における磁気検出素子68を設ける部分の厚みを磁気検出素子68を設けない部分の厚みより小さくしているため、磁性体67を流れる磁力線は磁気検出素子68を設ける部分で集磁されることになり、これにより、磁気検出素子68を通過する磁力線の量が増加するため、非接触型位置センサの出力感度が向上するという効果を有するものである。また前記磁性体67における一端部側と他端部側は補強磁性体70により磁氣的に接続されているもので、このように磁性体67における一端部側と他端部側を接続する補強磁性体70を設けると、磁性体67における一端部側と他端部側との間隙から外部に漏れようとする磁力線をこの補強磁性体70により吸収して磁気回路を構成することができるため、磁気検出素子68を通過する磁力線の量は増加することになり、これにより、非接触型位置センサの出力感度が向上するという効果を有するものである。

【0065】

71は回路基板で、この回路基板71の上面にはコンデンサ等の電子部品72を設けており、かつこの電子部品72は前記磁気検出素子68にリード端子68aを介して電氣的に接続されて前記磁気検出素子68で生じた出力信号を出力電圧に変換するものである。73は樹脂製のケースで、このケース73は底面から上方に向かってスリット74を設けた円筒部75を有しており、かつこの円筒部

75の外側面に位置して空隙76を設け、この空隙76に前記第1の磁石61におけるS極63と第2の磁石64におけるN極65および磁気検出素子68を臨ませている。また前記ケース73の外底面には下方へ突出するようにコネクタ端子77を設けており、かつこのコネクタ端子77は一端を前記回路基板71における電子部品72と電氣的に接続している。78は樹脂製の蓋で、この蓋78は前記ケース73における開口部を閉塞している。

【0066】

以上のように構成された本発明の実施の形態3における非接触型位置センサについて、次にその組立方法を説明する。

【0067】

まず、予め準備された第1の磁石61のN極62を磁性体67の一端部側の内側面に接着剤等により固着した後、同様に第2の磁石64のS極66を磁性体67の他端部側の内側面に接着剤等により固着する。

【0068】

次に、磁性体67における一端部側の先端と他端部側の先端とを、補強磁性体70により接着剤を使用して接続する。

【0069】

次に、回路基板71に磁気検出素子68および電子部品72を実装した後、はんだにより回路基板71に磁気検出素子68および電子部品72を電氣的に接続する。

【0070】

次に、予めコネクタ端子77を一体に成形したケース73の内側に、前記第1の磁石61、第2の磁石64、磁性体67、磁気検出素子68、補強磁性体70および回路基板71を収納する。

【0071】

最後に、ケース73の開口部を蓋78で閉塞する。

【0072】

以上のように構成され、かつ組み立てられた本発明の実施の形態3における非接触型位置センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。

【 0 0 7 3 】

図 1 4 は本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサの空隙に相手側回転軸を挿入した状態を示す斜視図である。

【 0 0 7 4 】

図 1 4 において、7 8 は金属製の相手側回転軸で、この相手側回転軸 7 8 は前記ケース 7 3 の円筒部 7 5 に挿入され、かつ先端部側に設けた半円形状部 7 9 を前記磁気検出素子 6 8 と第 1 の磁石 6 1 および第 2 の磁石 6 4 との間に形成される空隙 7 6 内に位置させている。このとき、第 1 の磁石 6 1 および第 2 の磁石 6 4 の幅を相手側回転軸 7 8 の直径に略一致させているため、第 1 の磁石 6 1 と第 2 の磁石 6 4 との間を通過しようとする磁力線が相手側回転軸 7 8 のない位置を通過するということとはなくなり、これにより、非接触型位置センサの出力特性が向上するという効果を有するものである。

【 0 0 7 5 】

そして、上記相手側回転軸 7 8 が回転すると、この回転に伴い、相手側回転軸 7 8 における半円形状部 7 9 が回転するため、この回転により、前記磁気検出素子 6 8 と第 1 の磁石 6 1 および第 2 の磁石 6 4 との間に形成される空隙 7 6 内に生じる磁束密度が変化するものである。

【 0 0 7 6 】

すなわち、図 1 5 (a) に示すように、相手側回転軸 7 8 における半円形状部 7 9 の回転角度が 0 度のときは、磁束密度は図 1 6 に示すように約 -40 mT であるが、回転角度が 45 度のときは、磁束密度は約 0 mT 、回転角度が 90 度のときは約 30 mT となるものである。

【 0 0 7 7 】

また、上記相手側回転軸 7 8 における半円形状部 7 9 の回転角度が 0 度のときは、第 2 の磁石 6 4 から半円形状部 7 9 を介して磁気検出素子 6 8 に至るまでの間隙が小となるため、図 1 5 (a) に示すように、相手側回転軸 7 8 側から磁気検出素子 6 8 に磁力が流れることになるが、半円形状部 7 9 の回転角度が 45 度のときは、第 2 の磁石 6 4 から半円形状部 7 9 を介して第 1 の磁石 6 1 に至るまでの間隙が小となるため、図 1 5 (b) に示すように、磁気検出素子 6 8 に磁力

が流れなくなる。そしてまた、相手側回動軸 7 8 における半円形状部 7 9 の回転角度が 9 0 度のときは、磁気検出素子 6 8 から半円形状部 7 9 を介して第 1 の磁石 6 1 に至るまでの間隙が小となるため、図 1 5 (c) に示すように、磁気検出素子 6 8 側から相手側回動軸 7 8 側に磁力が流れることになるものである。

【 0 0 7 8 】

そして、前記磁束密度の変化を磁気検出素子 6 8 により出力信号として検出し、この出力信号を回路基板 7 1 における電子部品 7 2 により出力電圧に変換し、コネクタ端子 7 7 を介して相手側コンピュータ等に出し、相手側回動軸 7 8 の回転角度を検出するものである。

【 0 0 7 9 】

上記本発明の実施の形態 3 においては、磁気検出素子 6 8 と第 1 の磁石 6 1 および第 2 の磁石 6 4 との間に形成される空隙 7 6 内に相手側回動軸 7 8 を設け、この相手側回動軸 7 8 の回転角度により、磁気検出素子 6 8 と第 1 の磁石 6 1 および第 2 の磁石 6 4 との間に形成される空隙 7 6 内に生じる磁束密度を変化させる構成としているため、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を設けることなく、相手側回動軸 7 8 の回転角度を容易に検出することができるものである。

【 0 0 8 0 】

また相手側回動軸 7 8 が偏芯した場合でも、従来のように相手側回動軸 7 8 の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回動軸 7 8 の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸 7 8 の回転角度の検出も正確に行えるものである。そしてまた非接触型位置センサを相手側回動軸 7 8 に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるものである。

【 0 0 8 1 】

さらに上記本発明の実施の形態 3 においては、相手側回動軸 7 8 における空隙 7 6 に位置する部分の形状を半円形状部 7 9 としているため、相手側回動軸 7 8 の回転角度により、相手側回動軸 7 8 における空隙 7 6 に位置する部分の磁束密度は変化することになり、これにより、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部

材を必要とすることなく、相手側回動軸 7 8 の回転角度を容易に検出することができるという効果を有するものである。

【0082】

なお、上記本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサにおいては、相手側回動軸 7 8 における空隙に位置する部分の形状を半円形状部 7 9 としたものについて説明したが、扇形状に構成した場合でも、本発明の実施の形態 3 と同様の効果を有するものである。

【0083】

【発明の効果】

以上のように本発明の非接触型位置センサは、N 極と S 極を有する磁石と、この磁石から発生する磁束の流れを集磁する磁性体とにより磁気回路を構成し、かつ前記磁性体における先端部間に位置して少なくとも 1 個の磁気検出素子を設け、さらに前記磁性体における先端部間または前記磁性体における先端部と前記磁石との間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたもので、この構成によれば、相手側回動軸の回転角度により、磁性体における先端部間または磁性体における先端部と磁石との間に形成される空隙内に位置する磁束密度が変化するため、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材を設けることなく、相手側回動軸の回転角度を容易に検出することができ、また相手側回動軸が偏芯した場合でも、従来のように相手側回動軸の先端部側に磁束シャッタを垂直方向に取り付けた構成ではないため、相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行え、さらに非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、従来のような磁束シャッタ等の複雑な部材がないため、両者を近接させて容易に組み付けることができるという作用を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサの蓋および回路基板を外した状態の上面図

【図 2】

同非接触型位置センサの側断面図

【図 3】

本発明の実施の形態 1 における非接触型位置センサの孔に相手側回動軸を挿入した状態を示す断面図

【図 4】

(a) (b) 同非接触型位置センサの動作状態を示す説明図

【図 5】

相手側回動軸の回転角度と磁束密度の関係を示す特性図

【図 6】

本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサの蓋および回路基板を外した状態の上面図

【図 7】

同非接触型位置センサの側断面図

【図 8】

本発明の実施の形態 2 における非接触型位置センサの孔に相手側回動軸を挿入した状態を示す断面図

【図 9】

(a) (b) (c) 同非接触型位置センサの動作状態を示す説明図

【図 10】

相手側回動軸の回転角度と磁束密度の関係を示す特性図

【図 11】

本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサの分解斜視図

【図 12】

同非接触型位置センサの蓋を外した状態の上面図

【図 13】

同非接触型位置センサの側断面図

【図 14】

本発明の実施の形態 3 における非接触型位置センサの空隙に相手側回動軸を挿入した状態を示す斜視図

【図 1 5】

(a) (b) (c) 同非接触型位置センサの動作状態を示す説明図

【図 1 6】

相手側の回動軸の回転角度と磁束密度の関係を示す特性図

【図 1 7】

従来の非接触型位置センサの分解斜視図

【図 1 8】

同非接触型位置センサの側断面図

【符号の説明】

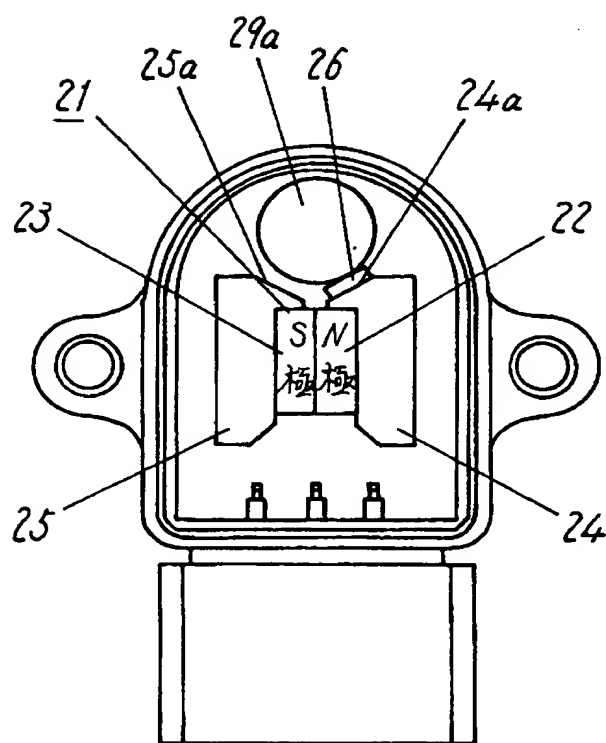
- 2 1, 4 1 磁石
- 2 2, 4 2, 6 2, 6 5 N極
- 2 3, 4 3, 6 3, 6 6 S極
- 2 4, 2 5, 4 4, 6 7 磁性体
- 2 4 a, 2 5 a, 4 4 a, 4 4 b 先端部
- 2 6, 4 5, 6 8 磁気検出素子
- 3 3, 5 3 相手側回動軸
- 3 4 扇形状部
- 5 4 I形状部
- 6 1 第 1 の磁石
- 6 4 第 2 の磁石
- 6 9 中間部
- 7 0 補強磁性体
- 7 6 空隙

【書類名】

図面

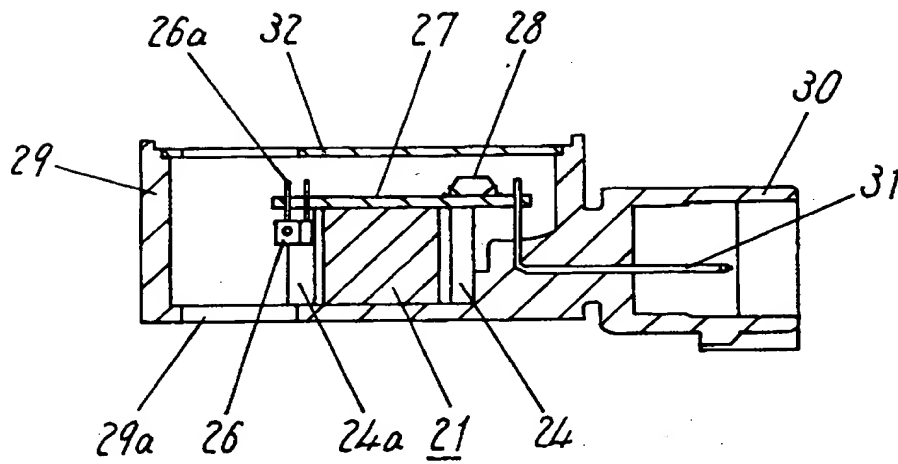
【図 1】

21 磁 石
22 N 極
23 S 極
24,25 磁性体
24a,25a 先端部
26 磁気検出素子



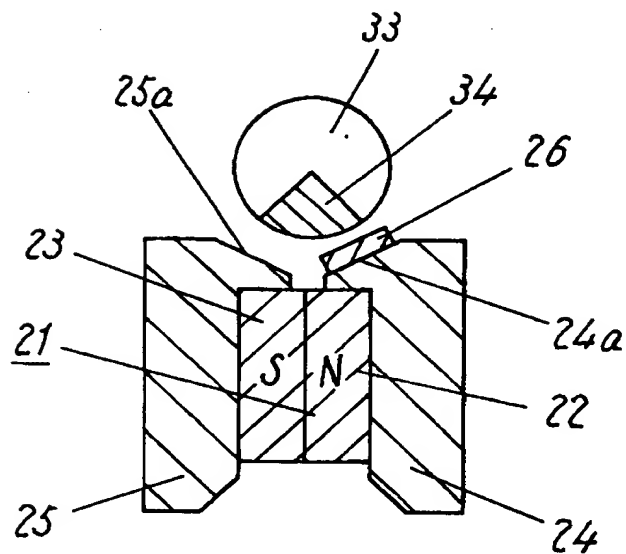
【図 2】

21 磁 石
 24 磁性体
 24a 先端部
 26 磁気検出素子



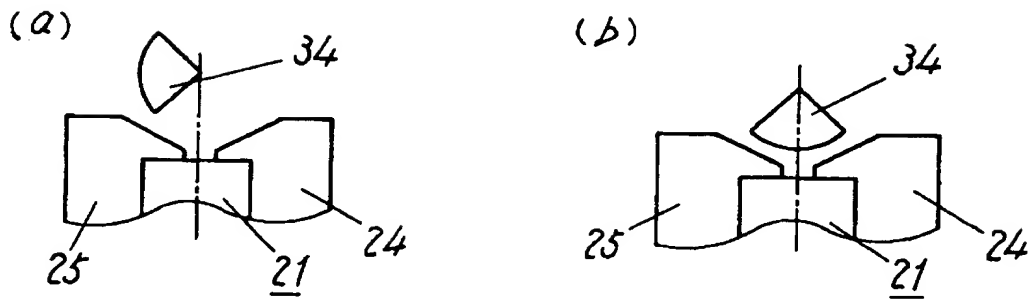
【図 3】

- 21 磁 石
- 22 N 極
- 23 S 極
- 24, 25 磁性体
- 24a, 25a 先端部
- 26 磁気検出素子
- 33 相手側回転軸
- 34 扇形状部

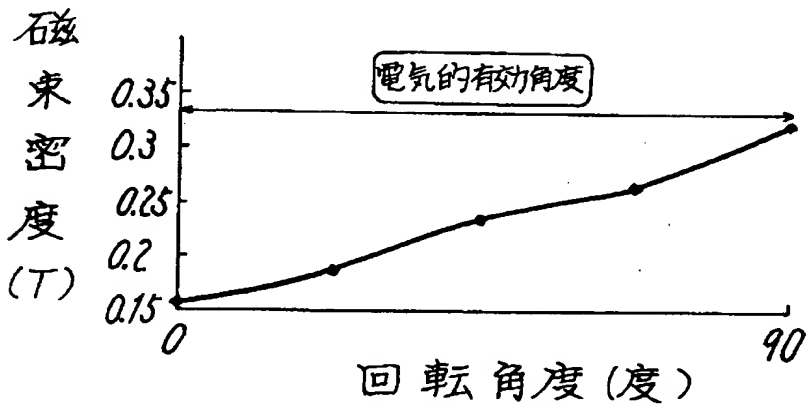


【图 4】

21 磁 石
24, 25 磁性体
34 扇形状部

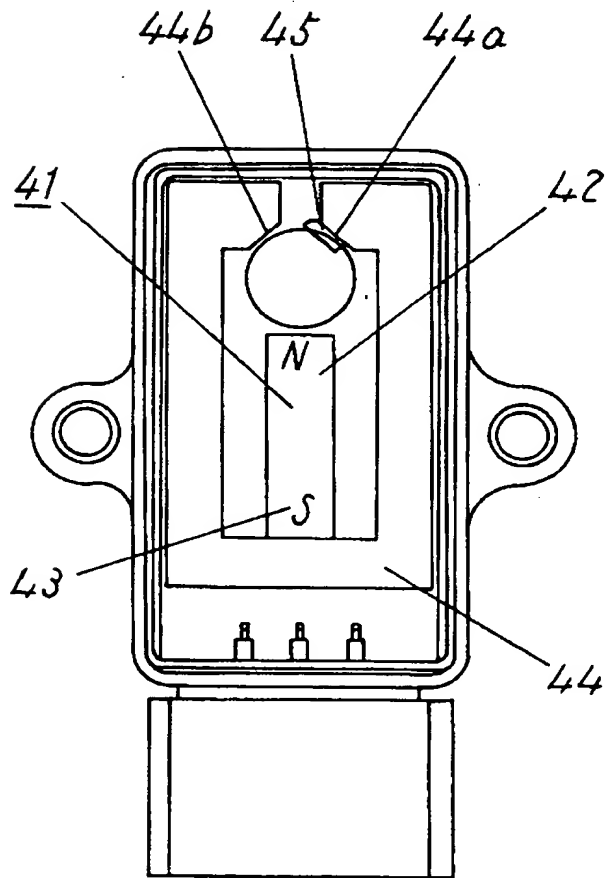


【图 5】



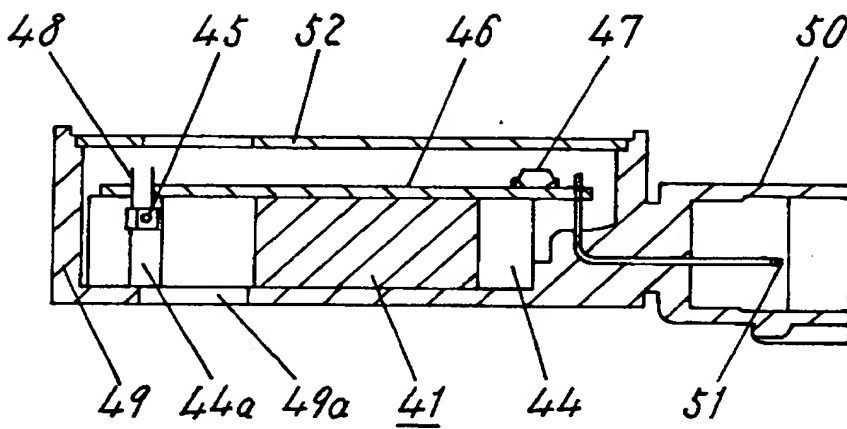
【図 6】

- 41 磁 石
- 42 N 極
- 43 S 極
- 44 磁性体
- 44a, 44b 先端部
- 45 磁気検出素子



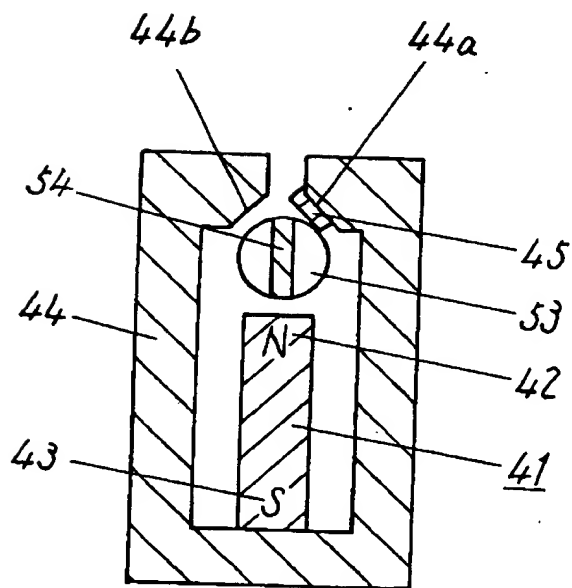
【図 7】

- 41 磁 石
- 44 磁性体
- 44a 先端部
- 45 磁気検出素子



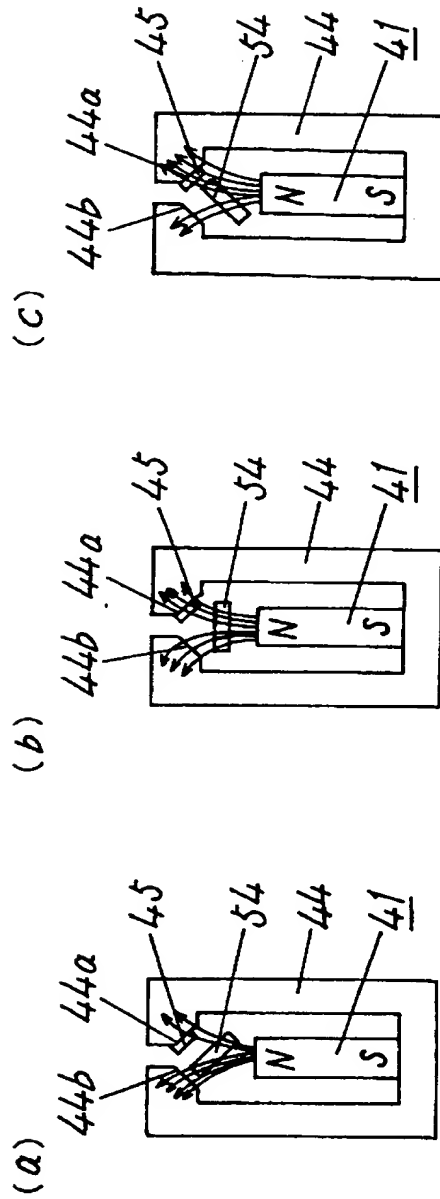
【図 8】

- 41 磁 石
- 42 N 極
- 43 S 極
- 44 磁性体
- 44a, 44b 先端部
- 45 磁気検出素子
- 53 相手側回転軸
- 54 I 形状部

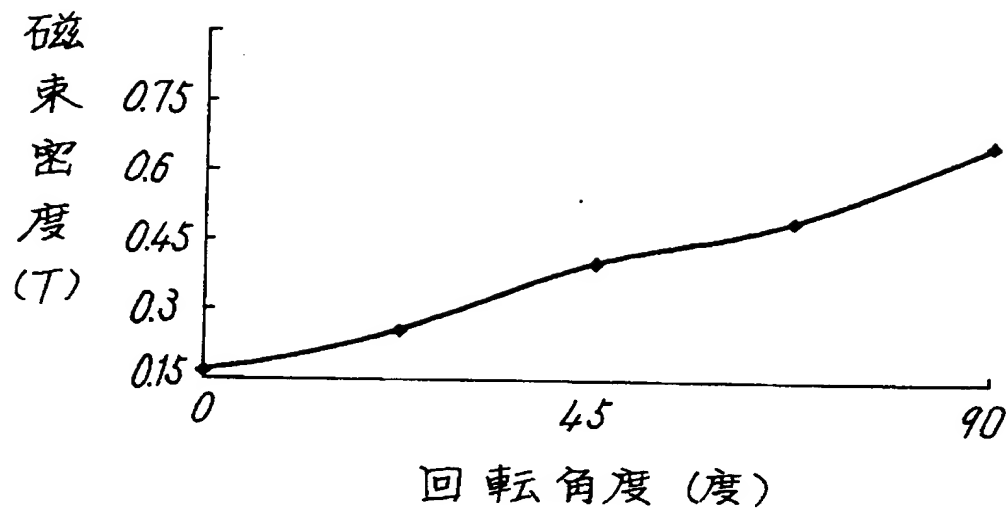


【図 9】

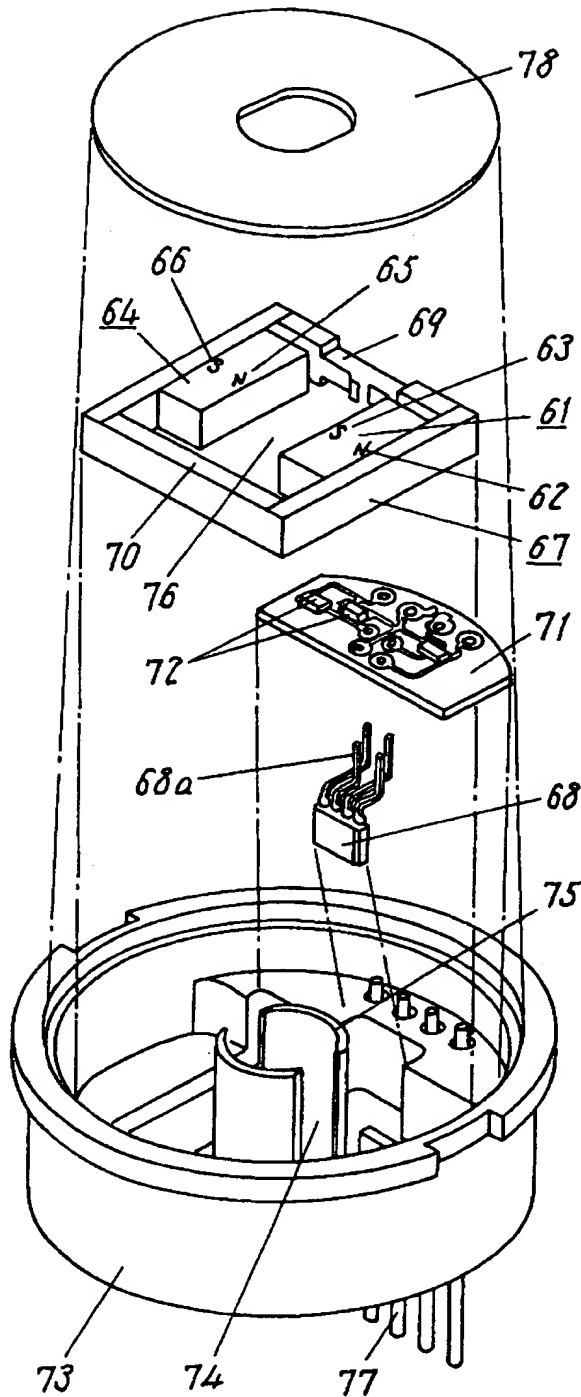
41 磁 石
 44 磁性体
 44a, 44b 先端部
 45 磁気検出素子
 54 I 形状部



【図 1 0】



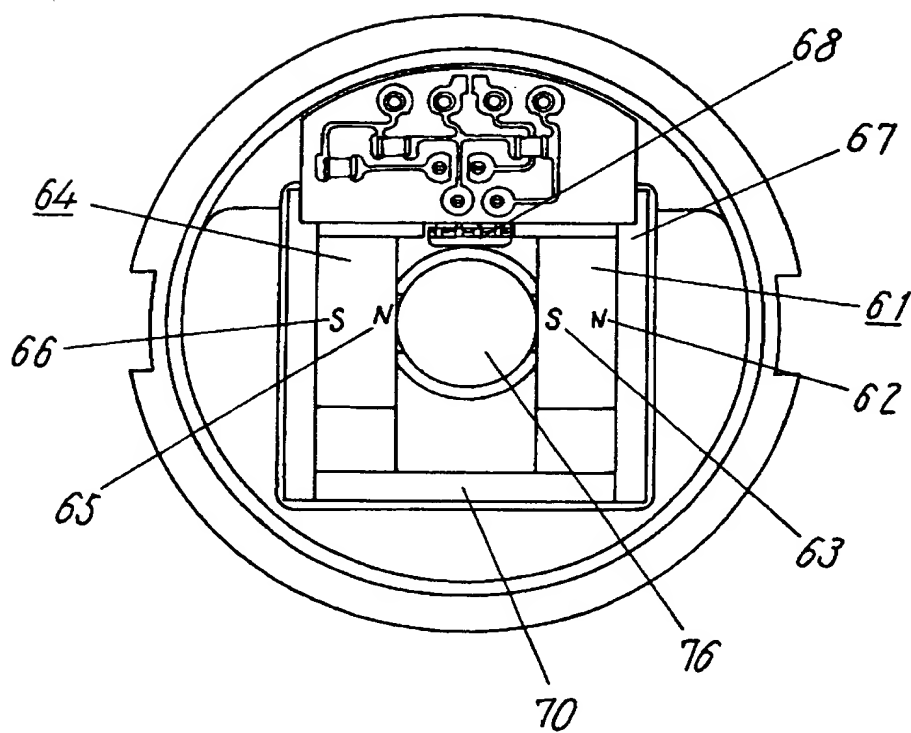
【図 11】



- 61 第1の磁石
- 62,65 N 極
- 63,66 S 極
- 64 第2の磁石
- 67 磁性体
- 68 磁気検出素子
- 69 中間部
- 70 補強磁性体
- 76 空隙

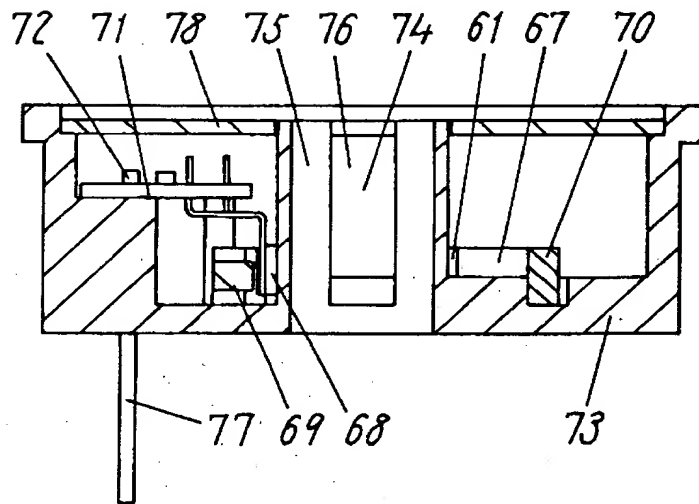
【図 1 2】

- 61 第1の磁石
- 62,65 N 極
- 63,66 S 極
- 64 第2の磁石
- 67 磁性体
- 68 磁気検出素子
- 70 補強磁性体
- 76 空 隙



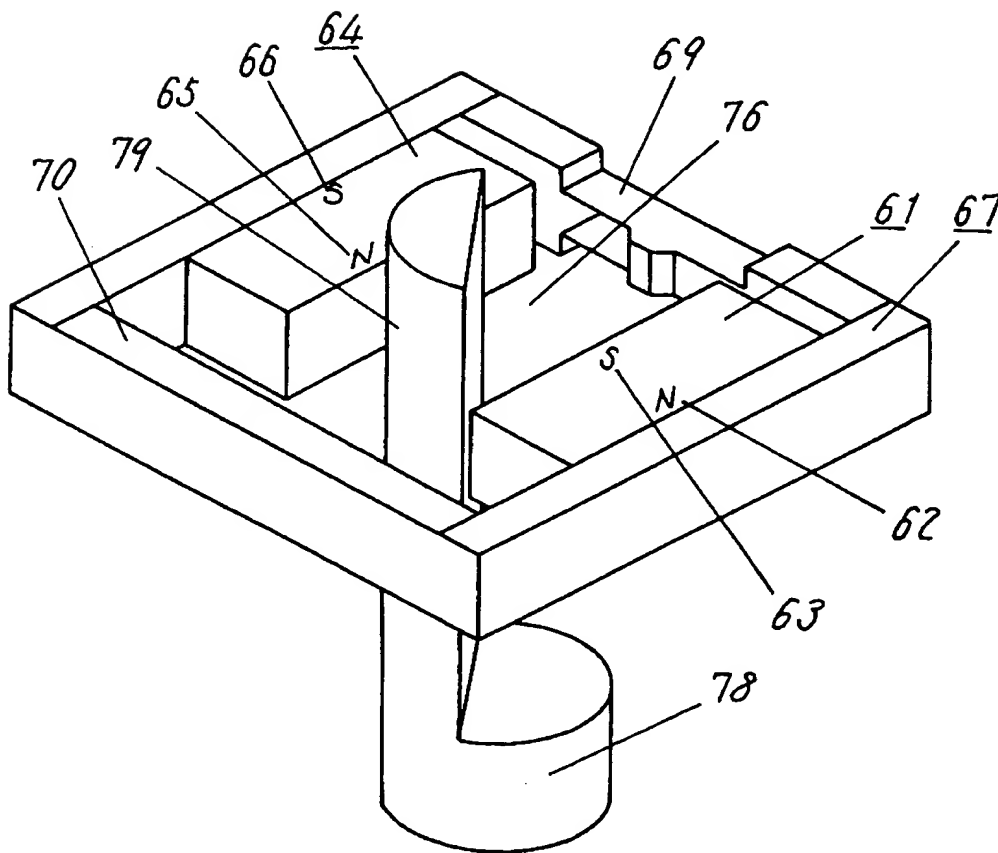
【図 1 3】

- 61 第1の磁石
- 67 磁性体
- 68 磁気検出素子
- 69 中間部
- 70 補強磁性体
- 76 空 隙



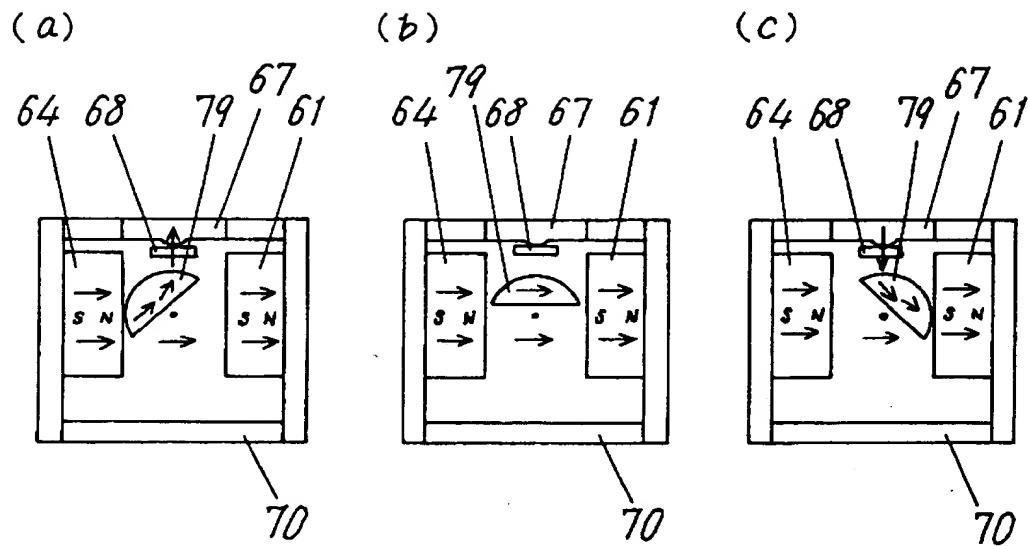
【図 14】

- 61 第1の磁石
- 62,65 N 極
- 63,66 S 極
- 67 磁性体
- 69 中間部
- 70 補強磁性体
- 76 空 隙
- 78 相手側回動軸
- 79 半円形状部

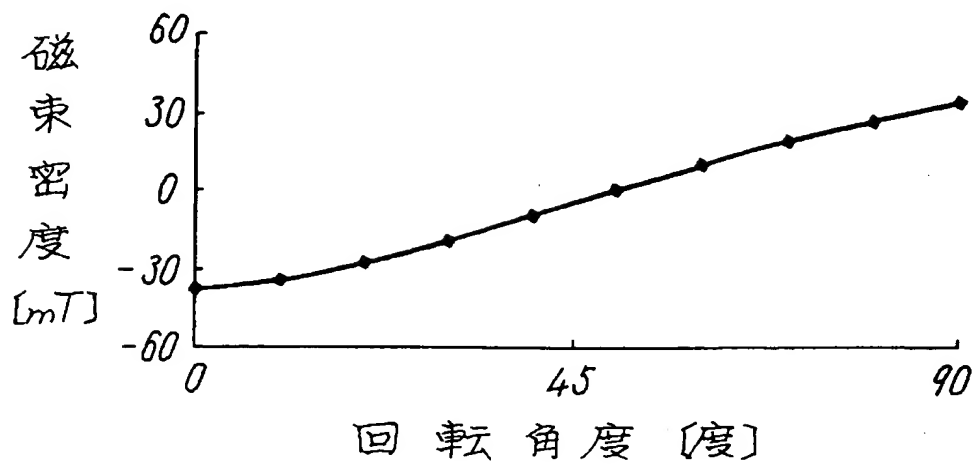


【図15】

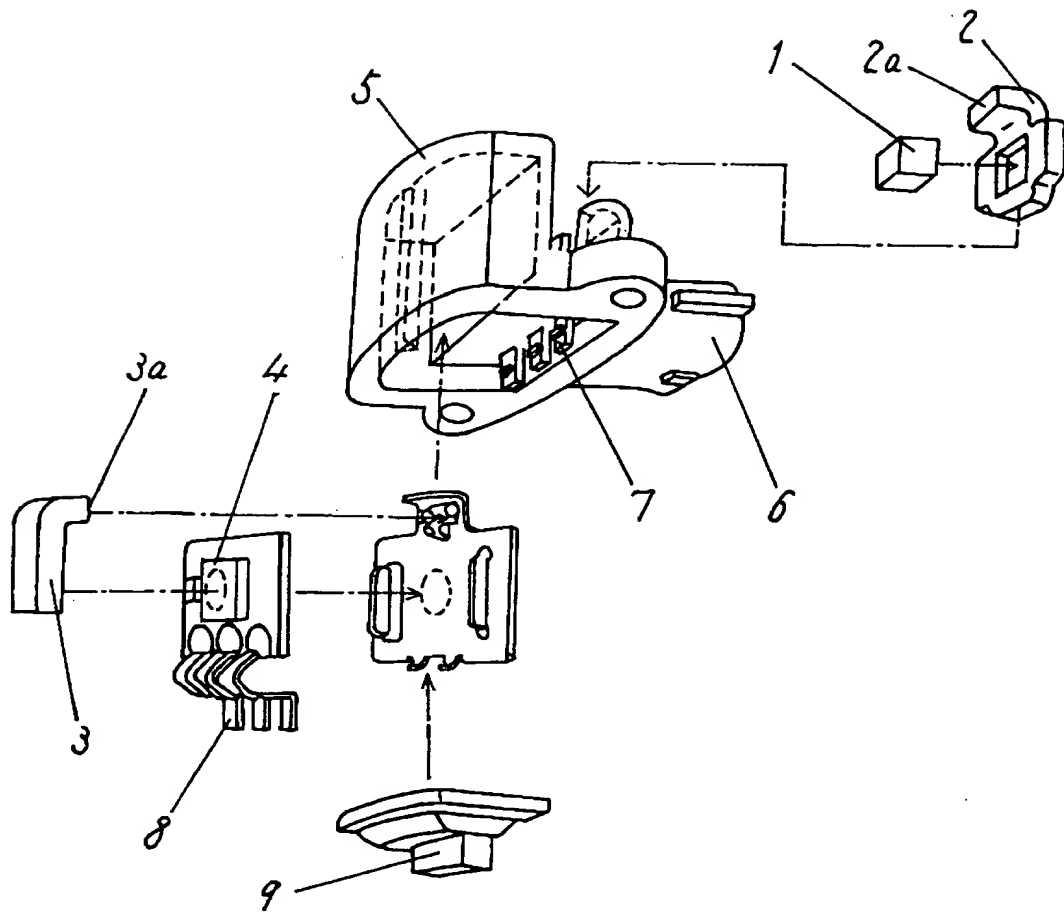
- 61 第1の磁石
- 64 第2の磁石
- 67 磁性体
- 68 磁気検出素子
- 70 補強磁性体
- 79 半円形状部



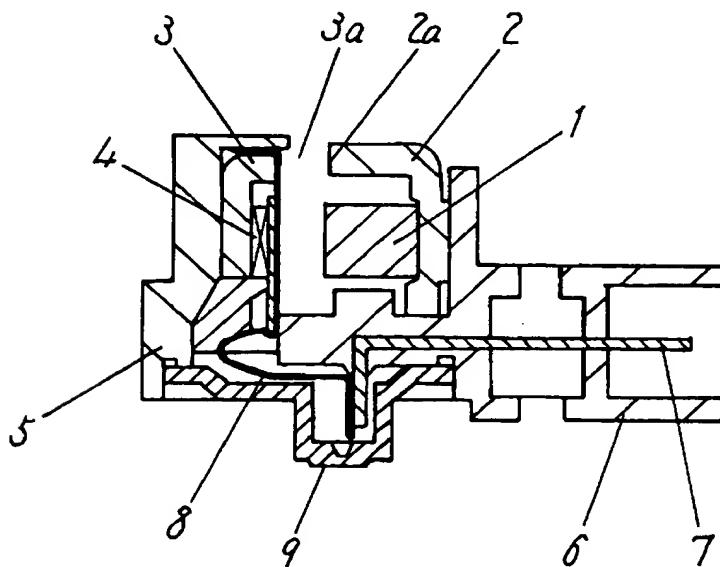
【図16】



【図 17】



【図 18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 相手側回動軸が偏芯した場合でも相手側回動軸の移動量を微小に抑えることができ、これにより、相手側回動軸の回転角度の検出も正確に行えるとともに、非接触型位置センサを相手側回動軸に組み付ける場合においても、両者を近接させて容易に組み付けることができる非接触型位置センサを提供することを目的とする。

【解決手段】 N極22とS極23を有する磁石21と、この磁石21から発生する磁束の流れを集磁する磁性体24、25とにより磁気回路を構成し、かつ磁性体24、25における先端部24a、25a間に位置して磁気検出素子26を設け、さらに磁性体24、25における先端部24a、25a間に形成される空隙内に相手側回動軸を設けるようにしたものである。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

氏 名 松下電器産業株式会社